

1. Record Nr.	UNISA996334349903316
Titolo	Journal of micro/nanolithography, MEMS, and MOEMS : JM ³
Pubbl/distr/stampa	[Bellingham, WA], : SPIE-The International Society of Optical Engineering, ©2007-
ISSN	1932-5134
Disciplina	620
Soggetti	Nanolithography Microelectronics Microlithography Microfabrication Periodicals.
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Periodico
Note generali	Refereed/Peer-reviewed